

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 3 区分
 【発行日】平成 25 年 5 月 16 日 (2013.5.16)

【公表番号】特表 2012-530964 (P2012-530964A)
 【公表日】平成 24 年 12 月 6 日 (2012.12.6)
 【年通号数】公開・登録公報 2012-051
 【出願番号】特願 2012-516079 (P2012-516079)
 【国際特許分類】

G 0 6 F 3/041 (2006.01)

G 0 6 F 3/044 (2006.01)

【F I】

G 0 6 F 3/041 3 5 0 C

G 0 6 F 3/044 E

G 0 6 F 3/041 3 3 0 A

G 0 6 F 3/041 3 3 0 D

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 3 月 25 日 (2013.3.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

コンピューティングデバイス用のマルチタッチ入力デバイスの製造方法であって、前記マルチタッチ入力デバイスが、湾曲した幾何学的外形を有する本体と、前記湾曲幾何学的外形の表面上において接触を検出するように構成されているマルチタッチ・センサーとを備えており、前記方法が、

可撓性絶縁基板上に、前記マルチタッチ・センサーの複数の画素を定めるセンサー・エレメントのアレイを形成するステップであって、各画素が前記湾曲幾何学的外形の表面上の位置において当該画素上の接触を検出するように構成されている、ステップと、

前記基板を、前記入力デバイスの本体の湾曲幾何学的外形の前記表面に沿った形状に形成するステップと、

前記基板を、前記入力デバイスの本体の湾曲幾何学的外形に固定するステップと、を備えている、方法。

【請求項 2】

請求項 1 記載の方法において、前記センサー・エレメントのアレイが、前記基板の第 1 側に形成されている第 1 組のセンサー・エレメントと、前記基板の前記第 1 側と反対側の第 2 側に形成されている第 2 組のセンサー・エレメントとを備えている、方法。

【請求項 3】

請求項 1 記載の方法において、前記センサー・エレメントのアレイを形成するステップが、前記基板の第 1 側に第 1 組のセンサー・エレメントを形成し、前記第 1 組のセンサー・エレメント上に誘電体層を形成し、次いで、前記誘電体層の上に第 2 組のセンサー・エレメントを形成するステップを含む、方法。

【請求項 4】

請求項 1 記載の方法において、前記センサー・エレメントのアレイを形成するステップが、前記基板の第 1 側に第 1 組のセンサー・エレメントと第 2 組のセンサー・エレメントとを形成し、前記 1 組のセンサー・エレメントのためのコネクタを形成し、前記第 1 組

のセンサー・エレメントのための１つ又は複数のコネクタの上に絶縁層を形成し、次いで各絶縁層の上に、前記第２組のセンサー・エレメントのためのコネクタを形成するステップを含む、方法。

【請求項５】

請求項１記載の方法において、前記基板を前記入力デバイスの本体の湾曲幾何学的外形に固定するステップが、前記基板をコンピューター・マウスの本体に固定するステップを含む、方法。